

G01Q 走査プロ - プ技術または装置; 走査プロ - プ技術の応用, 例. 走査プロ - プ型顕微鏡 [SPM][2010.01]

注

このサブクラスにおいては、ファ - ストプレイス優先ル - ルが適用となる、すなわち各階層レベルにおいて、相反する指示がない限り、最初の適切な箇所に分類する。
[2010.01]

10/00	走査または位置決め装置、すなわち、プロ - プの動きあるいは位置を積極的に制御するための装置 [2010.01]
10/02	・粗動走査または粗動位置決め [2010.01]
10/02 101	・圧電素子を用いたもの
10/02 111	・それらのための回路またはアルゴリズム
10/04	・微動走査または微動位置決め [2010.01]
10/04 101	・圧電素子を用いたもの
10/06	・それらのための回路またはアルゴリズム [2010.01]
20/00	プロ - プの動きまたは位置の監視 [2010.01]
20/02	・光学的手段によるもの [2010.01]
20/04	・自己検知プロ - プ、すなわち、プロ - プ自身がその位置を示すような信号を発するもの、例. 圧電ゲ - ジ [2010.01]
30/00	走査プロ - プ技術または装置の補助または改良に資する補助的手段、例. 表示装置またはデ - タ処理装置 [2010.01]
30/02	・非 SPM 分析装置、例. SEM[走査型電子顕微鏡], 分光計または光学顕微鏡 [2010.01]
30/04	・表示装置またはデ - タ処理装置 [2010.01]
30/06	・エラ - 補償のためのもの [2010.01]
30/08	・サンプルチェンバ - 内に所望の環境条件を確立し調節するための手段 [2010.01]
30/10	・温度環境 [2010.01]
30/12	・流体環境 [2010.01]
30/14	・液体環境 [2010.01]
30/16	・真空環境 [2010.01]
30/18	・外部の環境条件または影響からサンプルチェンバ - の内部を保護しあるいは隔離するための手段 [2010.01]
30/20	・試料の取扱装置または手段 [2010.01]
40/00	キャリブレ - ション、例. プロ - プのキャリブレ - ション [2010.01]
40/02	・キャリブレ - ションの基準またはその製造方法 [2010.01]
60/00	特定の型の SPM[走査プロ - プ型顕微鏡] またはそのための装置; その基本的な構成部品 [2010.01]
60/00 101	・プロ - プの特性
60/02	・マルチタイプ SPM, すなわち 2 つまたはそれ以上の SPM 技術を使用するもの [2010.01]
60/04	・STM[走査型トンネル顕微鏡法] と AFM[原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010.01]
60/06	・SNOM[近視野光学顕微鏡法] と AFM[原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010.01]
60/08	・MFM[磁気力顕微鏡法] と AFM[原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010.01]

60/10	・STM[走査型トンネル顕微鏡法] またはそのための装置、例. STM 用プロ - プ [2010.01]
60/12	・STS[走査型トンネルスペクトロスコピ -] [2010.01]
60/14	・STP[走査型トンネルポテンシオメトリ -] [2010.01]
60/16	・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01]
60/16 101	・プロ - プの特性
60/16 111	・プロ - プの製造
60/18	・SNOM[近視野光学顕微鏡法] またはそのための装置、例. SNOM 用のプロ - プ [2010.01]
60/20	・蛍光 [2010.01]
60/22	・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01]
60/22 101	・プロ - プの特性
60/22 111	・プロ - プの製造
60/24	・AFM[原子間力顕微鏡法] またはそのための装置、例. AFM 用のプロ - プ [2010.01]
60/26	・摩擦力顕微鏡法 [2010.01]
60/28	・凝着力顕微鏡法 [2010.01]
60/30	・走査型ポテンシャル顕微鏡法 [2010.01]
60/32	・AC モ - ド [2010.01]
60/34	・タッピングモ - ド [2010.01]
60/36	・DC モ - ド [2010.01]
60/38	・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01]
60/38 101	・プロ - プの特性
60/38 111	・プロ - プの製造
60/40	・導電性プロ - プ [2010.01]
60/42	・機能化 [2010.01]
60/44	・SICM[走査型イオンコンダクタンス顕微鏡法] またはそのための装置、例. SICM 用のプロ - プ [2010.01]
60/44 101	・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01]
60/46	・SCM[走査型キャパシタンス顕微鏡法] またはそのための装置、例. SCM 用のプロ - プ [2010.01]
60/48	・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01]
60/50	・MFM[磁気力顕微鏡法] またはそのための装置、例. MFM 用のプロ - プ [2010.01]
60/52	・磁気共鳴 [2010.01]
60/54	・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01]
60/54 101	・プロ - プの特性
60/54 111	・プロ - プの製造
60/56	・磁気コ - ティングされたプロ - プ [2010.01]
60/58	・SThM[走査型熱顕微鏡法] またはそのための装置、例. SThM 用のプロ - プ [2010.01]
60/60	・SECM[走査型電気化学顕微鏡法] またはそのための装置、例. SECM 用のプロ - プ [2010.01]
60/60 101	・プロ - プまたはその製造または関連する器具類、例. プロ - プホルダ - [2010.01]

70/00	SPM プロ - プの一般的観点またはその製造または関連する器具類で , グル - プ G01Q60/00 に包含される単一の SPM 技術に特に適合していないもの [2010.01]
70/02	・プロ - プホルダ - [2010.01]
70/04	・温度・震動に誘引されたエラ - の補償のあるもの [2010.01]
70/06	・プロ - プチップアレイ [2010.01]
70/08	・プロ - プの特性 [2010.01]
70/10	・形状またはテ - パ [2010.01]
70/12	・ナノチュ - プチップ [2010.01]
70/14	・特定の物質 [2010.01]
70/16	・プロ - プの製造 [2010.01]
70/18	・機能化 [2010.01]
80/00	SPM を除く走査プロ - プ技術の応用 (マイクロ構造の製造または処理 B81C; ナノ構造物の製造または処理 B82B3/00; 近接場相互作用を用いる情報の記録と再生 G11B9/12, G11B11/24, G11B13/08) [2010.01]
80/00 101	・情報記録装置への適用
80/00 111	・表面加工への適用
80/00 121	・生物試料への適用
90/00	他に分類されない走査プロ - プ技術または装置 [2010.01]
